کاتالوگ دستگاه تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی (ریداکشن)

مدل KRL5

شرکت هوشمند سازان

کیان گستر نیکا

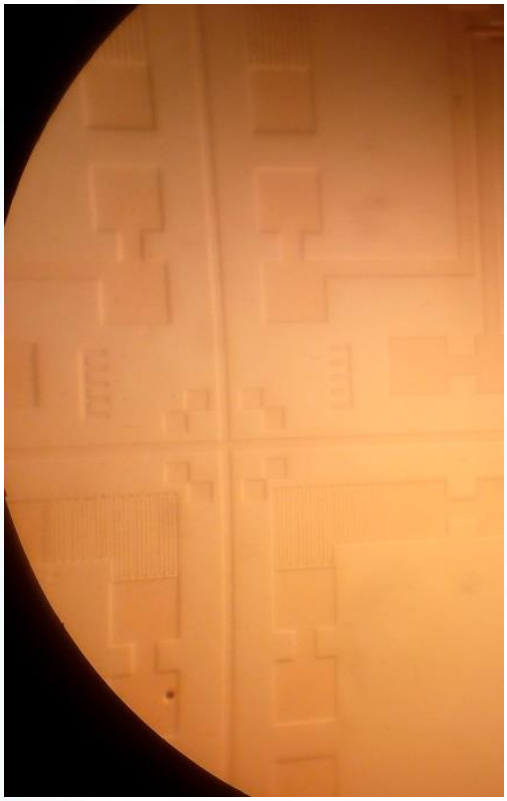
KGN
SMART SYSTEM

مزیت های دستگاه:

۱- قابلیت تغییر عدد کوچک سازی از ۳ تا ۱۰

۲- لیتوگرافی مستقیم تماسی با قرار دادن نمونه و ماسک بین چشمه نور و لنز

۳- دقت لیتوگرافی تا MFS= 2um



شکل ۱: تصویر میکروسکوپ اپتیکی از ماسکی که با استفاده از سامانه کوچک‌سازی ماسک، ۵ مرتبه کوچک سازی شده است.

KGN
SMART SYSTEM